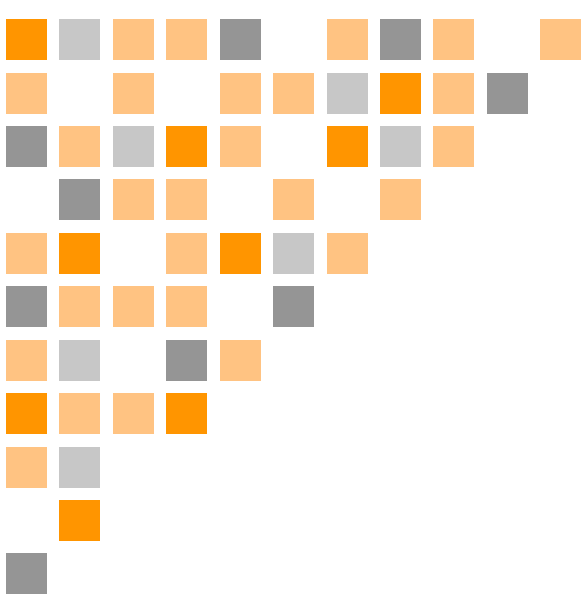




2026年12月期第2四半期 決算補足資料（2026年4-6月）

2026年8月12日
証券コード：6871

資料取扱い上の注意

- 本プレゼンテーションで述べられている内容は、当社が現時点で入手している情報及び合理的と判断する前提をもとに構成されたものです。
- 実際の業績や見通し等は、市況、競争状況、半導体業界の世界的な状況等を含む多くの不確実な様々な要因の影響を受けます。
- 従いまして、実際の今後の当社業績や見通しは、本プレゼンテーションにおける記述、その他の情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。



2026年12月期 第2四半期決算概要

決算概要

	2025年12月期	2026年12月期					
	4-6月	1-3月	4-6月	前四半期比		前年同期比	
	Q2 ①	Q1 ②	Q2 ③	増減額 ③-②	増減率	増減額 ③-①	増減率
(単位：百万円、百万円未満切捨)							
売上高	18,996	20,945	28,261	+7,315	+34.9%	+9,264	+48.8%
プローブカード事業	18,536	20,629	27,912	+7,283	+35.3%	+9,376	+50.6%
TE事業 ※	460	316	348	+32	+10.1%	▲ 112	-24.4%
売上総利益	8,787	9,898	15,217	+5,319	+53.7%	+6,430	+73.2%
営業利益	4,711	5,647	9,909	+4,261	+75.4%	+5,197	+110.3%
経常利益	4,492	5,991	10,268	+4,277	+71.4%	+5,776	+128.6%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,101	4,392	7,068	+2,675	+60.9%	+3,966	+127.9%

※：Test Equipment

決算概要

	2025年12月期	2026年12月期					
	第2四半期累計（1-6月）			5/13開示予想比		前年同期比	
	前年実績 ①	5/13開示予想 ②	実績 ③	増減額 ③-②	増減率	増減額 ③-①	増減率
(単位：百万円、百万円未満切捨)							
売上高	33,120	45,700	49,206	+3,506	+7.7%	+16,086	+48.6%
プローブカード事業	32,199	45,000	48,542	+3,542	+7.9%	+16,342	+50.8%
TE事業 ※	921	700	664	▲ 35	▲5.1%	▲ 256	▲27.9%
売上総利益	16,401	—	25,115	—	—	+8,714	+53.1%
営業利益	7,569	12,900	15,557	+2,657	+20.6%	+7,987	+105.5%
経常利益	7,394	12,700	16,260	+3,560	+28.0%	+8,865	+119.9%
親会社株主に帰属する 中間純利益	4,774	9,200	11,461	+2,261	+24.6%	+6,686	+140.0%

※：Test Equipment

2026年12月期第2四半期決算の要点

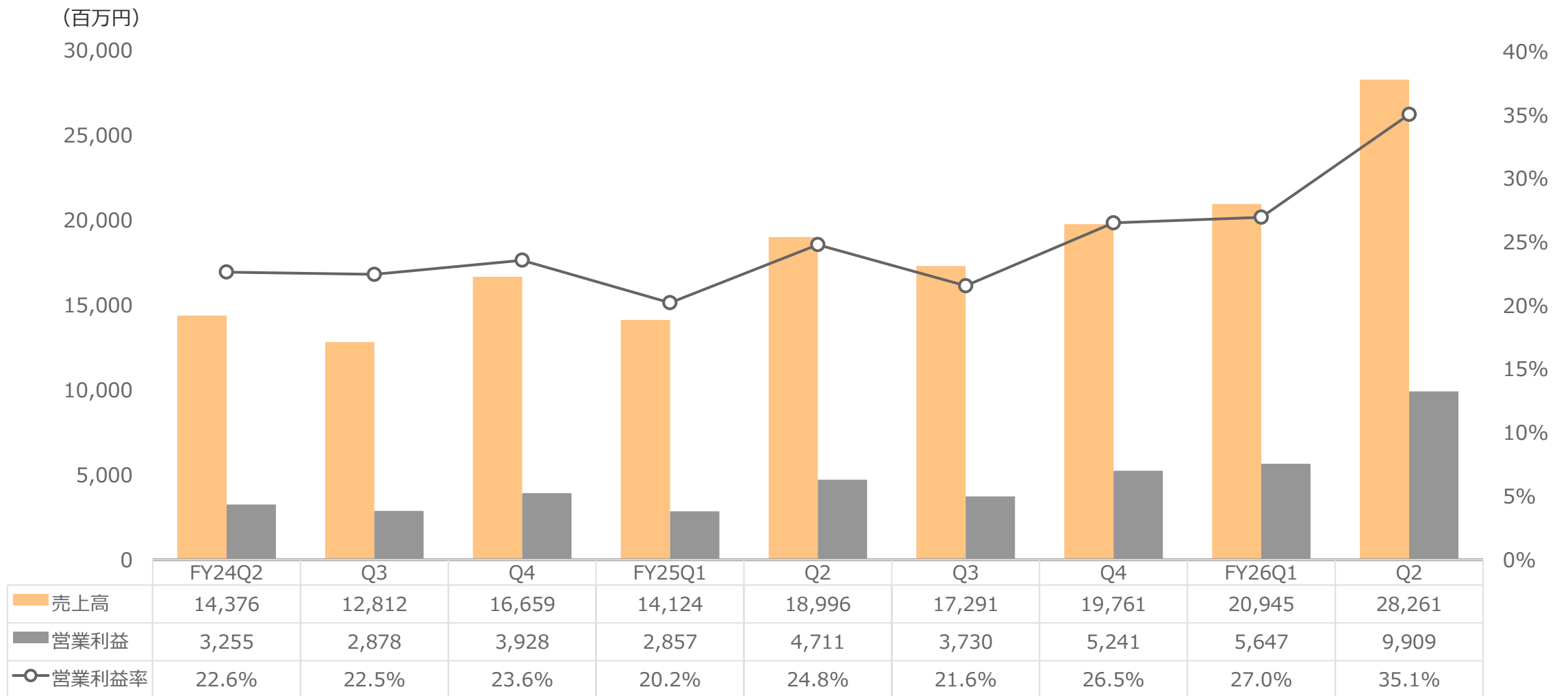
プローブカード事業

- メモリ向けプローブカードの売上高は、前四半期からのシフト及び生産能力の増強による売上げ前倒しを背景に、前四半期に続き過去最高を更新
- ノンメモリ向けプローブカードの売上高は、前四半期比で微増
- セグメント利益は、DRAM向け高付加価値品の貢献により前四半期比で増加
- 受注高は、前四半期比で大きく増加、HBM（広帯域メモリ）を中心にDRAMに対する需要は引き続き好調

TE事業

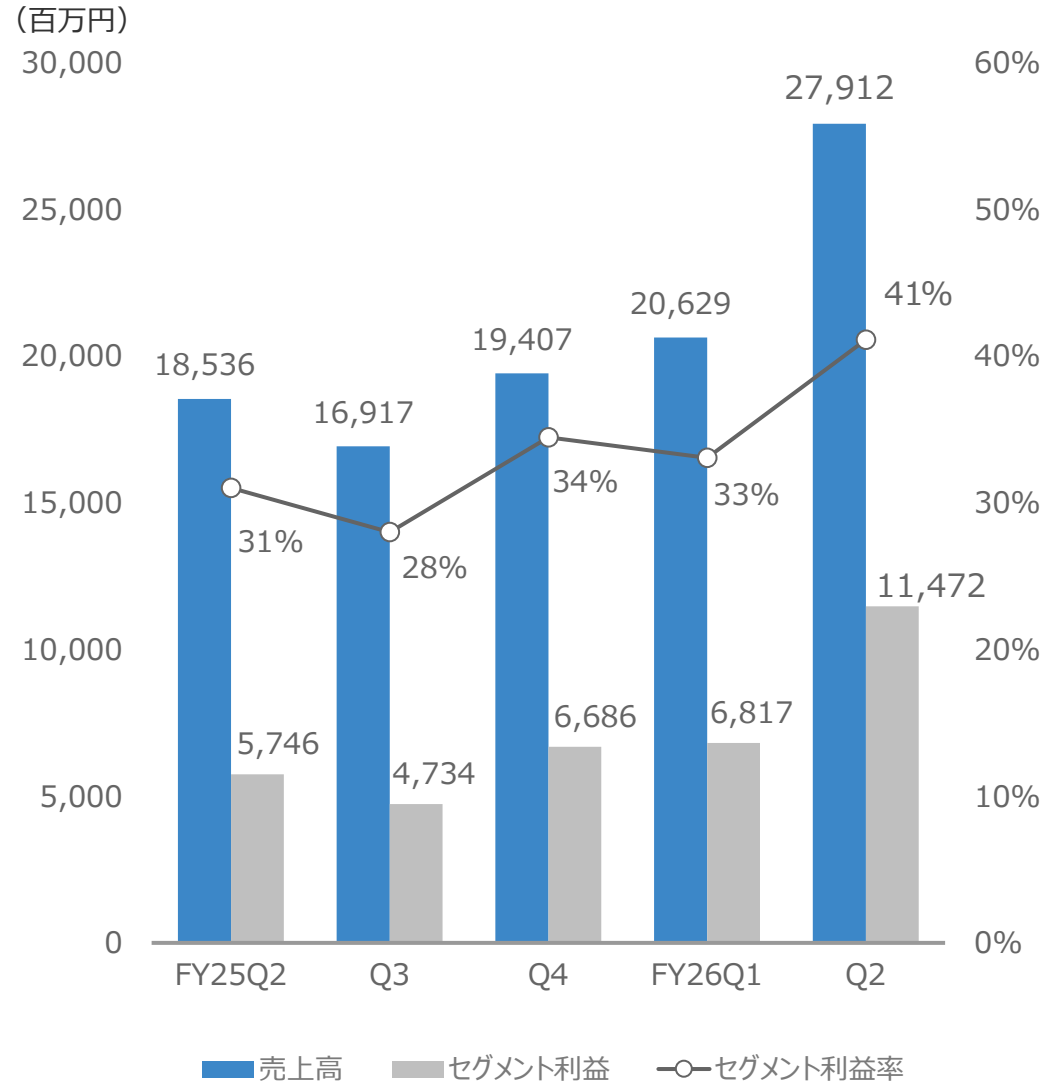
- 売上高は、半導体テストソケットが堅調に推移し、前四半期比で増加
- セグメント利益は、損失を計上
- 半導体テストTestalio・プローバExcelyzeの受注獲得に向け、顧客による評価中

四半期業績推移



四半期業績推移（セグメント別）

プローブカード事業

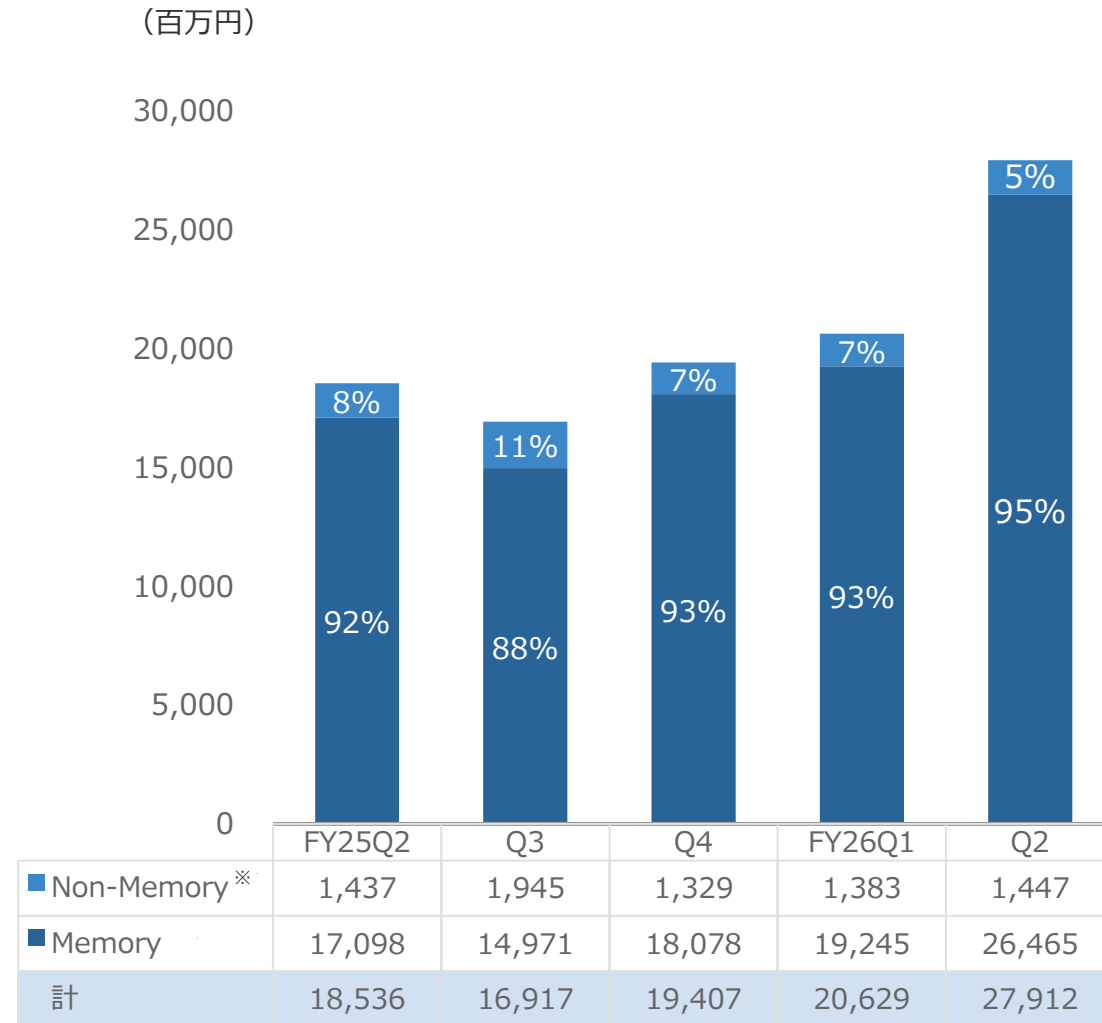


TE事業



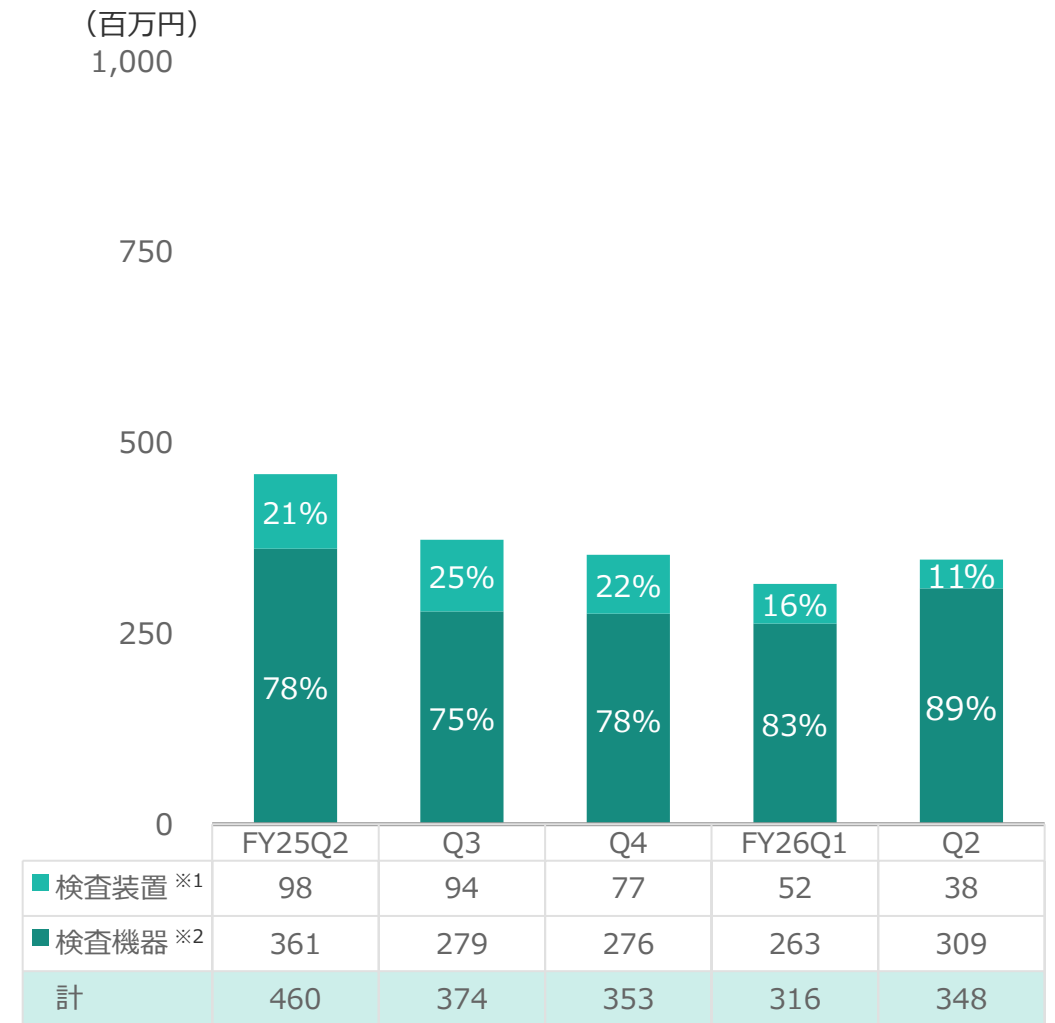
四半期売上高（製品別）

プローブカード事業



※カンチレバー型の売上高含む

TE事業



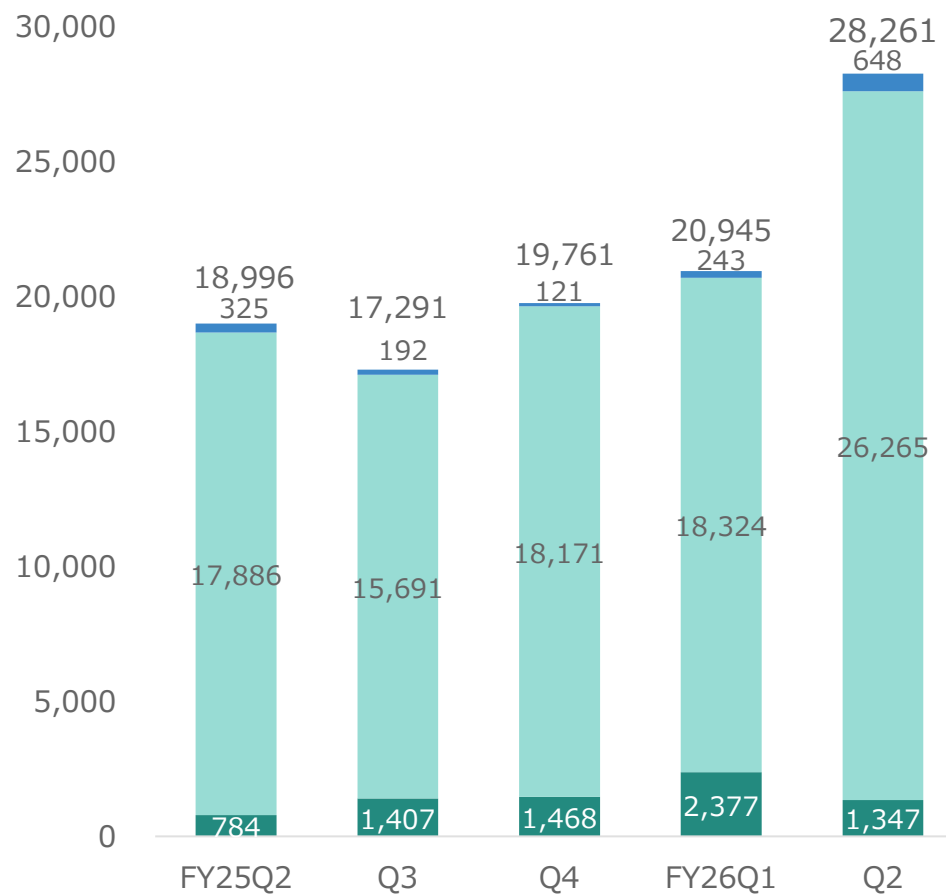
※1 カスタムテスタ、半導体プローバ、FPD向け検査装置など

※2 半導体向けテストソケット、FPD向けプローブユニット

地域別売上高 四半期推移

売上高

(百万円)

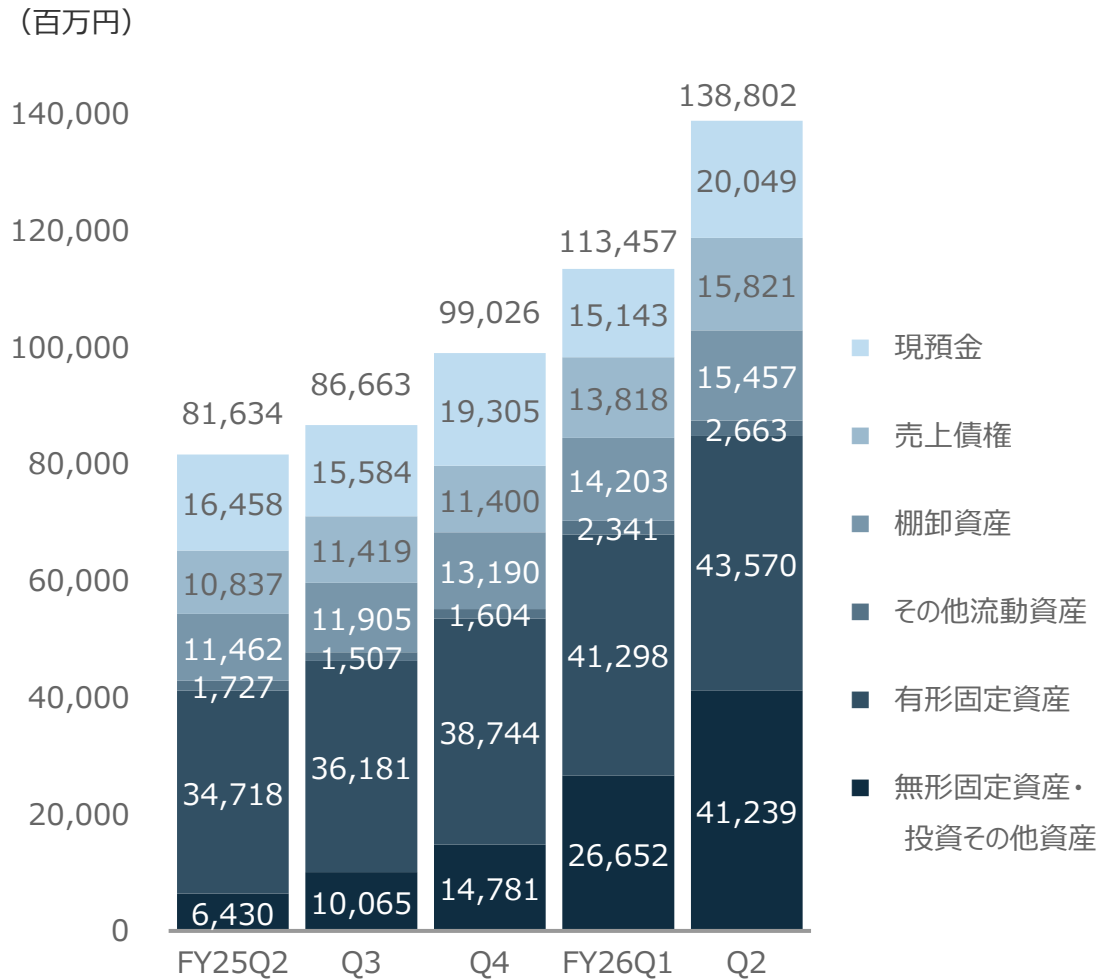


売上高比率

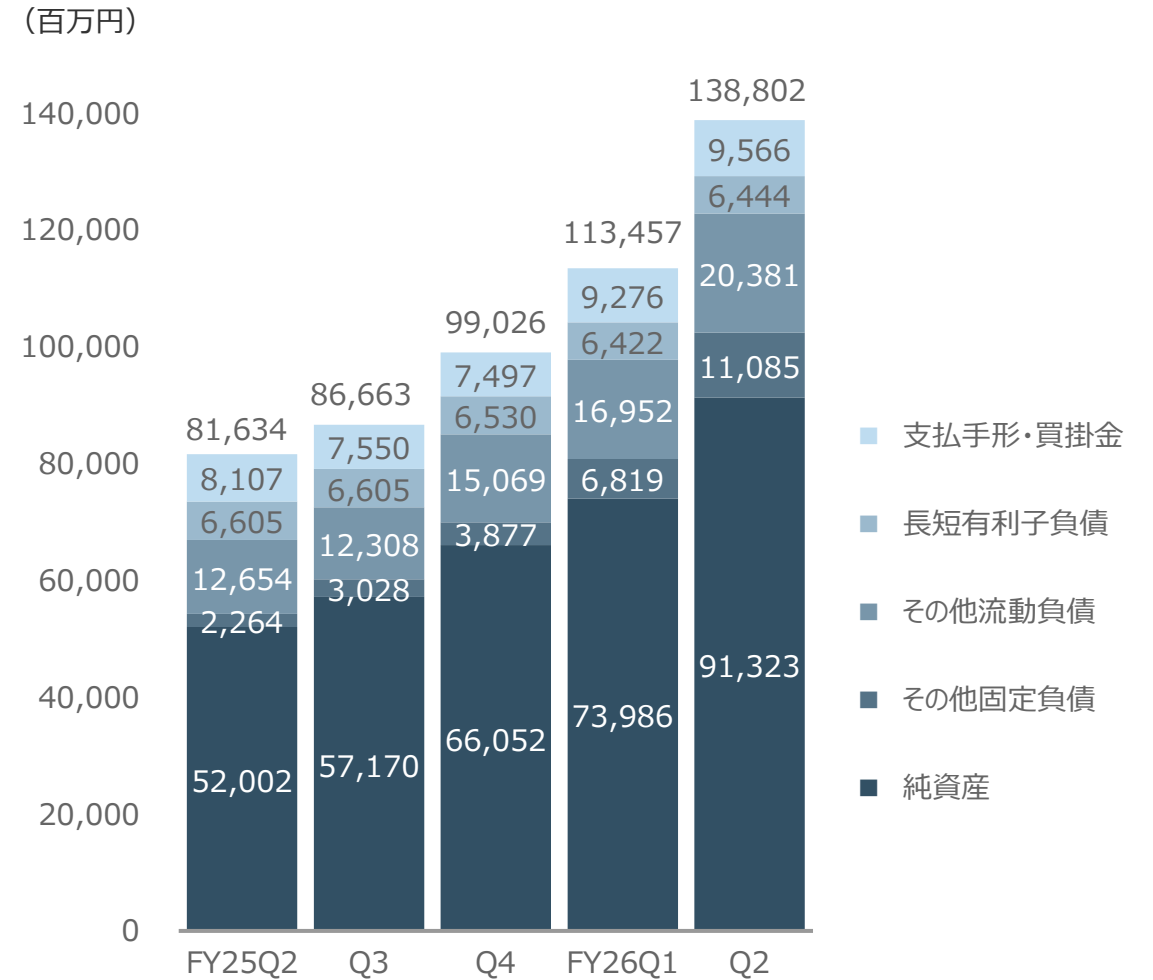


貸借対照表

資産の部

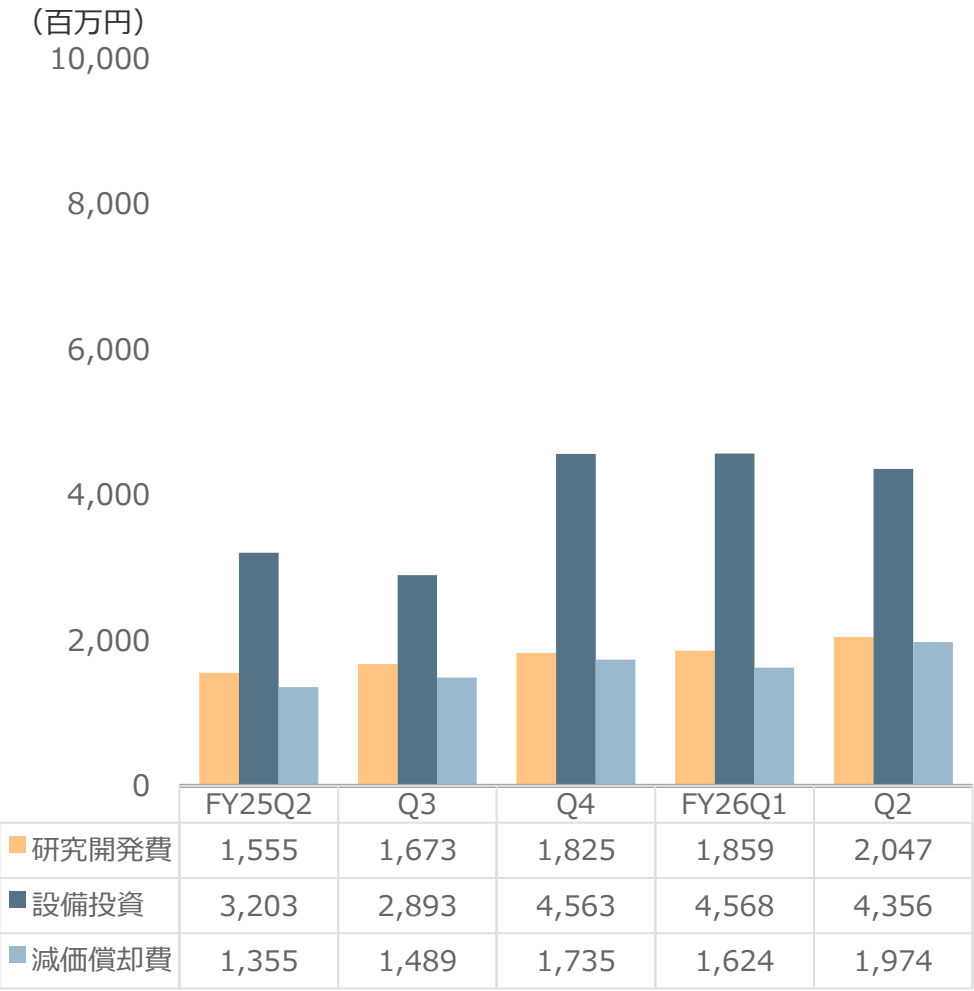


負債純資産の部



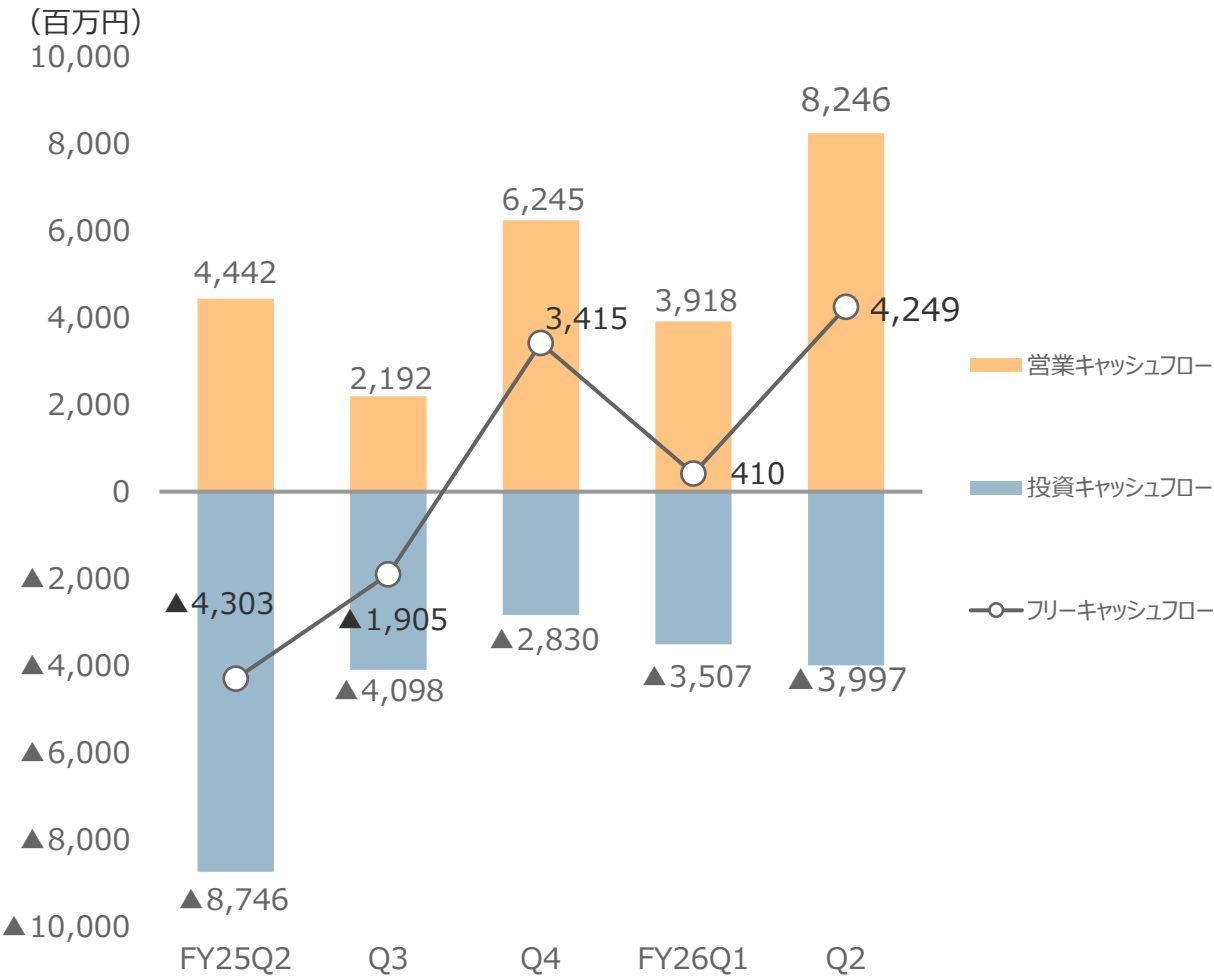
投資等/キャッシュフロー

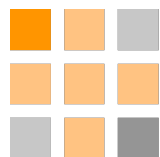
投資等



※設備投資には建設仮勘定を含む

キャッシュフロー





業績予想

業績予想

(単位：百万円、百万円未満切捨)	第3四半期（累計）業績予想						
	前年実績 ①	前回開示 (5/13時点) ②	今回 (8/12時点) ③	前回開示比		前年同期比	
				増減額 ③-②	増減率	増減額 ③-①	増減率
売上高	50,412	71,600	74,200	+2,600	+3.6%	+23,787	+47.2%
プローブカード事業	49,117	70,400	73,000	+2,600	+3.7%	+23,882	+48.6%
TE事業	1,295	1,200	1,100	▲100	▲8.3%	▲195	▲15.1%
営業利益	11,300	21,900	22,400	+500	+2.3%	+11,099	+98.2%
経常利益	11,273	21,400	23,100	+1,700	+7.9%	+11,826	+104.9%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	7,084	15,200	16,300	+1,100	+7.2%	+9,215	+130.1%

・ 2026年12月期想定レート：USD：156.00円／ドル、KRW：0.10円／ウォン

業績予想

(単位：百万円、百万円未満切捨)	通期（累計）業績予想			
	前年1-12月期 ①	1-12 (8/12時点) ②	前年同期比	
			増減額 ②-①	増減率
売上高	70,173	103,800	+33,626	+47.9%
プローブカード事業	68,525	102,000	+33,474	+48.9%
TE事業	1,648	1,700	+51	+3.1%
営業利益	16,542	31,400	+14,857	+89.8%
経常利益	17,100	32,000	+14,899	+87.1%
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,063	23,000	+10,936	+90.7%
配当予想（円）	95円	178円	+83円	—

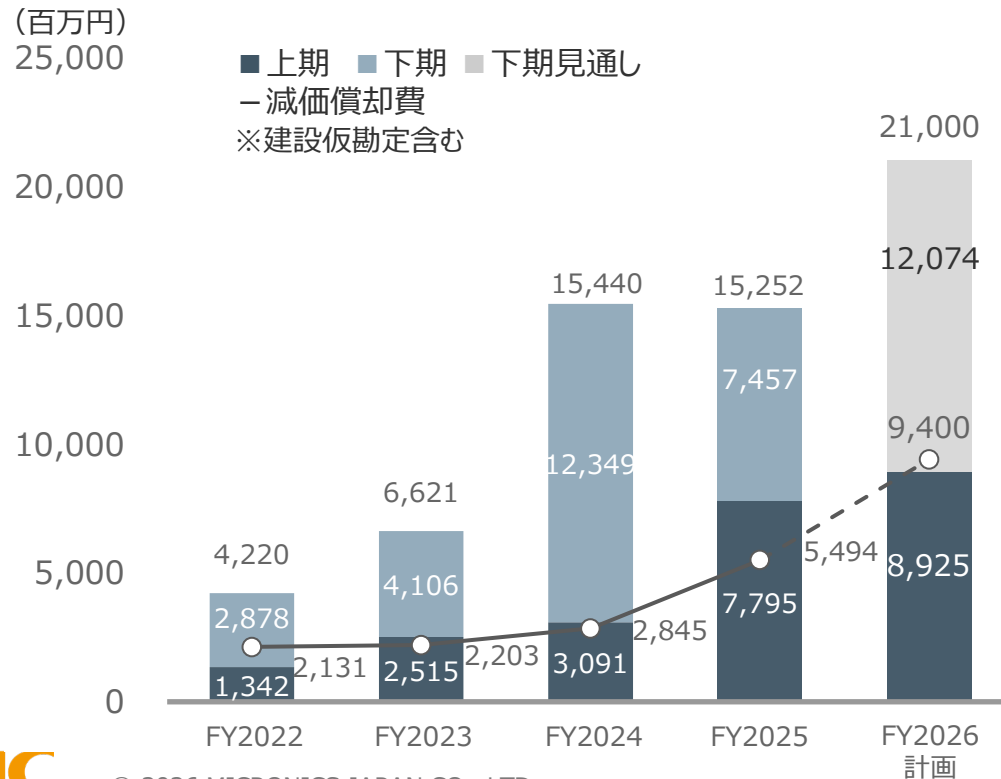
- ・ 2026年12月期想定レート：USD：156.00円／ドル、KRW：0.10円／ウォン

設備投資、研究開発投資

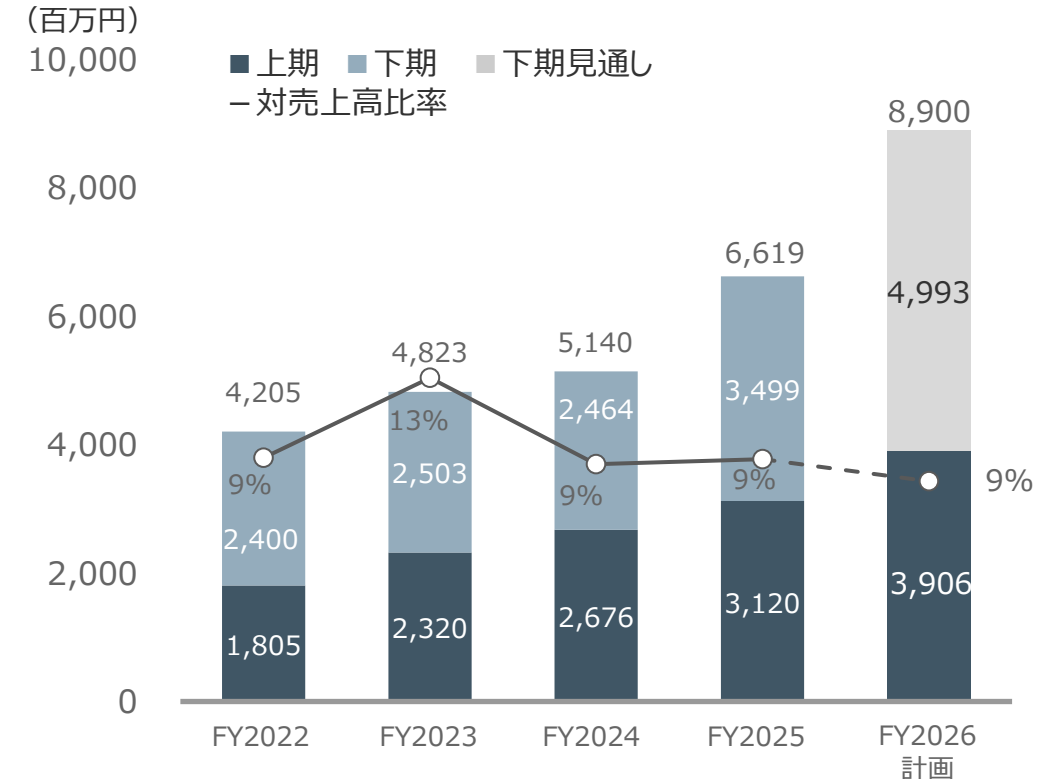
中長期の半導体市場の拡大を見据えながら、足元の旺盛なメモリ向けプロブカード需要に対して、積極的な生産能力の増強を前倒しで計画

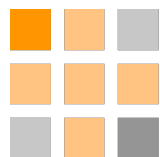
- 青森工場新棟への生産設備投資を可能な限り前倒し
- 半導体技術の進展を見据え、次世代プロブカードの技術開発を加速
- TestalioとExcelyzeの受注獲得に向け、顧客先での評価を推進

設備投資



研究開発投資





用語集及び主な製品のご紹介

用語集

ウェーハ Wafer :

シリコン (Si) やガリウム砒素 (GaAs) などを円柱状に結晶化させ、それを薄く切り出した円形状の基板で、表面に半導体の電子回路が形成される。

チップ/ダイ chip/die :

半導体の細片。半導体ウェーハをダイシングして一つの半導体デバイスに切り出したもの。

IC Integrated circuit : 集積回路の総称

メモリIC Memory IC :

情報を電氣的に格納して蓄積しておく記憶素子。DRAM、NAND型フラッシュメモリなどの種類がある。

ロジックIC Logic IC :

情報を制御するための論理回路で構成されており、論理演算処理に用いられる。

DRAM Dynamic Random Access Memory :

揮発性メモリの一つ。コンピュータの主記憶装置の他、一般的な汎用メモリとして、広範囲に利用されている。

NAND型フラッシュメモリ Nand-type flash memory :

外部から電源を供給しなくても内容が消えない不揮発性メモリの一つ。USBメモリやデジタルカメラ用メモリカード、携帯音楽プレーヤ、携帯電話の記憶装置として利用されている。東芝が1987年に提案した。

LSI Large Scale Integrated circuit :

大規模集積回路の総称。トランジスタの集積度向上に従って、VLSI、ULSIと呼ばれる。

マイコン Micro computer :

演算処理をおこなうマイクロプロセッサとメモリを1チップに集積したICのこと。最近では、家電製品などの電子制御用として組み込まれているものを指すことが多い。

SoC System on chip / システムLSI :

システムのほとんどの機能を1チップ上で実現した大規模なIC。これまで複数のICを組み合わせで構成していた機能を1チップに集約したもの。小型で高性能な機器を実現できる。主に、プロセッサとメモリ、入出力回路、インタフェース回路、通信回路などから構成される。

フリップチップ flip chip :

ICチップを高密度で配線板に表面実装するため、ICチップ表面部の電極にバンパと呼ばれる突起電極があるチップ。この突起と配線板の端子とを半田付け又は導電接着剤で接続する。

バンパ bump :

ICの電極部にメッキ等で形成した突起のこと。通常、金(Au)または半田で形成し、フリップチップ等における基板接続のために使用する。

ボンディングパッド bonding pad:

チップへの電源電圧の供給や外部との信号のやりとりは、通常リード線を介しておこなわれる。このリード線と内部回路の各端子とを接続するため、チップ周辺部に設けた金属電極のことを指す。

IoT Internet of Things :

世の中の様々な機器をインターネットで相互接続し、自動認識や自動制御、遠隔操作等を行うこと。一般的に、通信やセンサなどの半導体が使われる。

FPD Flat Panel Display : フラットパネルディスプレイ

LCD Liquid Crystal Display : 液晶ディスプレイ

用語集

ウェーハテスト/プローブテスト Wafer Test/Probe Test :
ウェーハチップのボンディングパット上にプローブ針を当てておこなう電氣的試験。

ファイナルテスト/パッケージテスト Wafer Test/Probe Test :
組立て完了したICに対しておこなう電氣的試験。

DUT device under test : 試験対象となるデバイス。

エリアアレイ Area array : 検査パッドがチップ表面に格子状に配列された状態のこと。

カンチレバー型プローブカード :
片持ち針型とも言う。ニードルプローブの片側を支点としてプロービングするプローブカードのこと。手作業により形成。

アドバンスドプローブカード :
カンチレバー型以外のプローブカードの総称。

垂直型プローブカード Vertical Probe Card :
基板に対しプローブが垂直に立てられているプローブカードのこと。エリアアレイ、小パッド、低電圧、低針圧、高周波の測定に適している。

MEMS micro electro-mechanical systems :
微小電気機械システム。

MEMS型プローブカード MEMS Type Probe Card :
MEMS技術を利用したプローブカード。プローブ端子自体が何らかの機械的動作を持つ構造。

DFT Design for testability :
テスト容易化設計。設計の初期の段階からテストのし易さを考慮して、テスト用回路の組み込み等を行う設計手法。

BIST Built In Self Test : 組み込み自己検査。DFTの一つ。

AI Artificial Intelligence :
コンピュータ上で人工的に人間と同様の知能を実現させようとする技術。一般的に、画像処理などの半導体が使われる。

生成AI :
オリジナルの画像・動画・テキスト・映像など多様な形式のデータを自動的に生成する技術。事前に収集・分析した膨大なデータを学習し、新たなコンテンツを生成できることが特徴。生成AIが性能を発揮するためには、GPUやHBMといった高性能半導体が不可欠。

GPU Graphics Processing Unit :
3Dグラフィックスなどの膨大なデータの計算処理をおこなう半導体チップで、並列計算能力が高い。特に生成AI向けは、HBMを組み合わせることでより高速な処理をおこなう。

HBM High Bandwidth Memory :
広帯域かつ消費電力効率の高いDRAMの一種。DRAMチップを積層し、多数のバスを用いてプロセッサと接続することで、高速で大容量のデータ転送を実現する。主にGPU/CPUとパッケージングされ、HPCやAIサーバなどに搭載される。

HPC High Performance Computing :
膨大なデータに対して複雑な演算処理を高速に実行する技術で、高性能なプロセッサを使用してビッグデータを処理することが可能。

汎用サーバ :
ユーザーからの要求に対し、ネットワークを通じて必要な処理をおこなうコンピュータやプログラム。

AIサーバ :
生成AIの学習と推論に特化した特殊なサーバ。強力なCPU、GPU、HBM、その他のデバイスが搭載され、より高い計算能力、大容量のメモristレージ、高帯域幅、低遅延などの特性を持つ。

データセンタ :
サーバやネットワーク機器を安全に保管するための施設。データセンタ向け投資が活発になると、汎用サーバが多く使用され、そこに搭載されるDRAMチップの需要が増加する。

主な製品のご紹介

プローブカード事業

U-Probe :

当社独自のMEMSプローブ“マイクロカンチレバー”と世界トップレベルの薄膜多層技術により、世界で初めてウェーハスケールのプロービングを実現した当社の主力製品。
DRAM向け三日月配置は、コンタクト回数を極限まで減らしたことで、現在業界のスタンダードとなりました。主に、DRAMやフラッシュメモリ等メモリ検査に使用される。

SP-Probe :

12インチウェーハ一括測定に適した垂直型スプリング・ピンタイプのプロブカード。主に、NANDフラッシュメモリ検査に使用される。

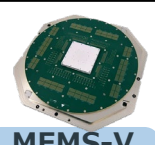
MEMS-V / Vertical-Probe :

高集積化・高速化・多ピン化するロジック検査用の垂直型ニードルタイプのプロブカード。あらゆるパッド配列に対し柔軟な対応が可能で、狭ピッチのエリアレイ配置、多数個同時測定に適し、SoC等先端ロジック検査に適している。

MEMS-SP :

SoCデバイス等のフリップチップタイプのロジック検査用に開発したMEMSプローブ使用のプロブカード。

当社プローブカード製品の主な用途

	Memory		Logic	
	DRAM	Flash	SoC	
垂直型		 SP-Probe	 Vertical-Probe	 SP-Probe
MEMS型	 U-Probe	 MEMS-V	 MEMS-SP	

TE事業

半導体テスト :

半導体デバイスに電気信号などを与え、出力される信号を期待値と比較することで、設計仕様通りに動作するかどうかを検査する装置。

ウェーハプローバ :

ウェーハを搬送しデバイス上の決められた位置にコンタクトするために使用する装置。

テストソケット :

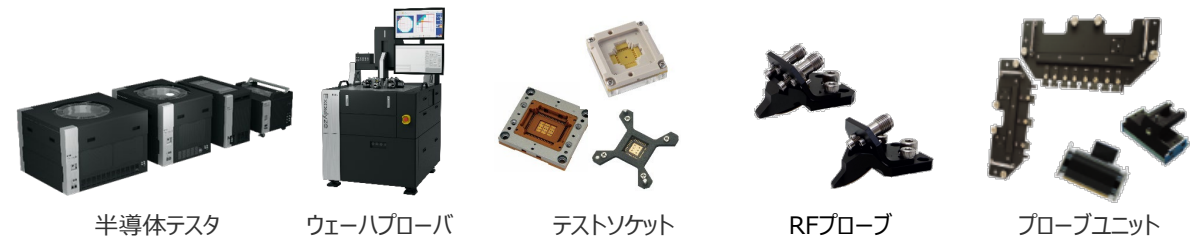
半導体製造の最終検査で、パッケージされたデバイスとテストを電気的に繋ぐ役目をもつ治具。
高周波・高性能デバイスに適した“J-Contacts”と、接触安定性に優れた独自構造のスプリングプローブをもつ“BeeContacts”の2タイプ。

RFプローブ :

ラジオ波やマイクロ波等の測定に適した高周波プローブ

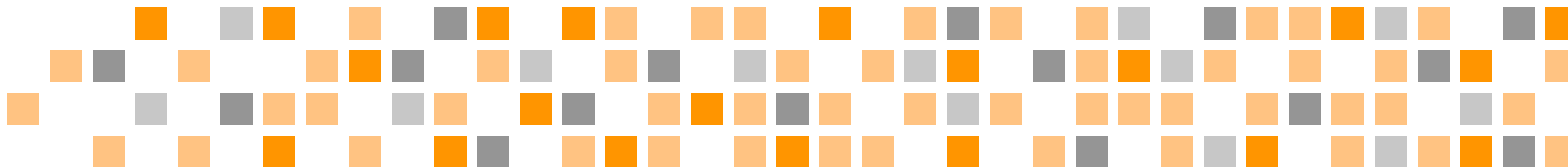
プローブユニット :

LCDプローバに搭載するLCD版プローブカード。当社が開発したブレードタイプは業界のスタンダードとなりました。





MJC YOUR Best Partner, MJC Anytime Anywhere



本資料で述べられている技術情報は、製品の標準的動作・応用を説明するための
ものであり、その使用に際して当社および第三者の知的財産、その他の権利に対する
保証または実施権の許諾を行なうものではありません。